

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和2年4月23日(2020.4.23)

【公開番号】特開2018-176139(P2018-176139A)

【公開日】平成30年11月15日(2018.11.15)

【年通号数】公開・登録公報2018-044

【出願番号】特願2017-84282(P2017-84282)

【国際特許分類】

B 09 B 3/00 (2006.01)

B 01 D 53/38 (2006.01)

B 01 D 53/58 (2006.01)

B 01 D 53/75 (2006.01)

B 01 D 53/78 (2006.01)

【F I】

B 09 B 3/00 3 0 2 F

B 01 D 53/38 1 5 0

B 01 D 53/58 Z A B

B 01 D 53/75

B 01 D 53/78

B 01 D 53/38 1 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和2年3月10日(2020.3.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 5】

水槽31の内部で水面の上方には、仕切板36が設けられている。洗浄装置30に供給されたガスは、仕切板36と水面との間を流れスクラバー室37に供給される。ガスが仕切板36と水面との間を流れることにより、ガスを水Wと接触させることができ、ガスに含まれるアンモニア等の水溶性の成分を水Wに吸収させて取り除くことができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図6】

